2017. Том 58, № 8

Ноябрь – декабрь

C. 1527 – 1533

УДК 544.344.9

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИОННОГО ХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ В СИСТЕМЕ Та—С—Si—O—F

В.В. Лозанов¹, Н.И. Бакланова¹, Д.А. Пирязев²

¹Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск, Россия E-mail: Lozanov.25@gmail.com ²Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск, Россия

Статья поступила 20 мая 2017 г.

Экспериментально и теоретически исследованы процессы реакционного осаждения карбидов тантала в системе Ta—C—Si—O—F. Показано, что SiO₂ оказывает существенное влияние на процесс карбидообразования. Это выражается в уменьшении эффективности переноса тантала из зоны источника в зону кристаллизации, в возможности двустороннего транспорта тантала на углерод и углерода на тантал, в усложнении состава конденсированных фаз, находящихся в равновесии с газовой фазой. Рассмотрены вопросы получения монокристаллического оксофторида тантала.

DOI: 10.26902/JSC20170801

Ключевые слова: термодинамическое моделирование, осаждение из газовой фазы, карбид тантала, оксофторид тантала, монокристалл.

введение

Реакционное химическое осаждение из газовой фазы (reactive chemical vapour deposition, RCVD) является эффективным методом получения тугоплавких соединений в виде порошков, покрытий и монокристаллов [1, 2]. Его сущность заключается в том, что твердое вещество А (зона источника), реагируя с газообразным веществом, образует газообразные продукты, которые после переноса в другую часть реактора при изменении условий равновесия реагируют с другим твердым веществом (С) с образованием продукта АС (зона кристаллизации). Необходимым условием осуществления химического переноса вещества в объеме реактора является наличие градиента химических потенциалов [1, 2].

Привлекательной особенностью метода является то, что в условиях RCVD можно получать вещества, температура плавления которых в несколько раз превышает температуру синтеза. В работах [3—5] методом изотермического RCVD в системах М—С—Наl, где М — тугоплавкий металл Ta, Ti, Hf; С — углерод, а Hal — галоген или галогенсодержащий компонент, например CF₄, были получены тугоплавкие карбиды тантала, титана, гафния при температурах 900—1000 °C. Термодинамическое моделирование систем Ta—C—Cl, Ta—C—F и Hf—C—F показало, что металл может переноситься через газовую фазу посредством низших галогенидов, причем эффективность переноса увеличивается при повышении температуры и уменьшении общего давления. Экспериментальные результаты подтвердили выводы термодинамического моделирования.

Ранее было обнаружено, что процессы массопереноса металла в виде газообразных галогенидов на углерод могут осложняться побочным взаимодействием галогенидов металла с мате-

[©] Лозанов В.В., Бакланова Н.И., Пирязев Д.А., 2017

риалом реактора — кварцем [1, 6]. Было установлено, что в результате такого взаимодействия происходит образование кислородсодержащих соединений металлов, например оксидов и/или оксофторидов. Можно отметить, что в последние годы резко возрос интерес к исследованию свойств оксофторидов тантала и ниобия, а также к методам их получения [7, 8]. Привлекательность этих соединений связана прежде всего с их фотокаталитическими и люминесцентными свойствами. Согласно литературным данным, основным методом получения оксофторидов тантала и ниобия в настоящее время является гидротермальный синтез, однако этот подход приводит к образованию дефектных структур [7, 8]. Альтернативным подходом получения оксофторидов металлов может быть RCVD метод.

В настоящей работе была поставлена цель — провести термодинамическое моделирование гетерогенной многокомпонентной системы Ta—C—Si—O—F и экспериментально изучить химические транспортные реакции в этой системе.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЕТЕРОГЕННЫХ РАВНОВЕСИЙ В СИСТЕМЕ Та-C-Si-O-F

Ранее нами было проведено термодинамическое моделирование системы Та—С—F [4]. Для оценки влияния кварца на процессы, протекающие в этой системе, в настоящей работе в расчеты был введен 1 моль SiO₂. Термодинамическое моделирование в системе Та—С—Si— О—F было проведено в интервале температур 1100—1600 К с шагом в 100 К и давлений 1—1000 Торр с шагом в один порядок. Расчет был проведен с использованием прикладной программы расчета физико-химических равновесий и базы данных стандартных термодинамических величин БД СМЭТ [9]. Данные по фторидам и оксофторидам тантала были взяты из работы [10].

Результаты расчета молекулярного состава газовой фазы, находящейся в равновесии с конденсированными фазами в зоне источника — тантала, представлены на рис. 1. Отметим, что на рис. 1 представлены только компоненты, парциальные давления которых для рассчитанных интервалов *P*, *T* всегда больше 10^{-8} Topp. Эта группа компонентов включает SiF₄, SiF₃, SiF₂, TaF₅, TaF₄, TaOF₃. Из рис. 1 видно, что основным компонентом газовой фазы в зоне источника во всем рассчитанном интервале температур и давлений является SiF₄ (более 90 % об.), а содержание TaF₅ примерно в 10 раз меньше содержания SiF₄. Из низших фторидов тантала только TaF₄ присутствует в заметных количествах (*P* = 0,13 Topp при *T* = 1600 K и *P* = 1000 Topp). Содержание TaOF₃ может достигать 0,001 % (об.). Согласно результатам моделирования, в равновесии с газовой фазой в зоне источника находятся конденсированные фазы Ta, TaO, Ta₂C и Ta₉Si₂.



Рис. 1. Равновесный молекулярный состав газовой фазы в зоне тантала. Приведены компоненты, содержание которых превышает 10⁻⁸ Торр

Рис. 2. Равновесный молекулярный состав газовой фазы в зоне кристаллизации (зона углерода). Приведены компоненты, содержание которых превышает 10⁻⁸ Торр

Рассмотрим реакции с участием значимых кислородсодержащих компонентов этой системы. Из результатов расчета следует, что разложение оксофторида тантала является термодинамически выгодной реакцией. Далее Ta₂O₅ может реагировать с танталом с образованием фазы TaO:

5TaO

$$F_3 \leftrightarrow Ta_2O_5 + 3TaF_5, \quad K_p = 10^{39} - 10^{19},$$
 (1)

$$Ta_2O_5 + 3Ta = 5TaO.$$

Образование силицида тантала может происходить за счет взаимодействия фторидов кремния с металлическим танталом, а образование карбида тантала за счет реакции Та с CF₄.

Рассмотрим зону кристаллизации, в которой располагается углерод (рис. 2). Парциальное давление TaF_4 в зоне кристаллизации при T = 1600 К и P = 1000 Торр составляет 0,016 Торр, что примерно на один порядок меньше, чем в зоне источника. Парциальное давление TaF_5 составляет 95,62 Торр, что практически совпадает с парциальным давлением этого компонента в зоне источника при тех параметрах расчета (95,56 Торр). Сравнительный анализ значений парциальных давлений фторидов тантала в зоне источника и кристаллизации приводит к заключению, что низшие фториды тантала являются транспортирующими агентами. При этом в зоне кристаллизации происходит взаимодействие низших фторидов тантала с углеродом, например, по реакции (3):

$$5 \text{TaF}_4 + \text{C} \leftrightarrow \text{TaC} + 4 \text{TaF}_5, \quad K_p = 10^{30} - 10^{16}.$$
 (3)

Ранее нами был проведен термодинамический расчет равновесного молекулярного состава газовой фазы в системе Та—С—F [4]. Сравнительный анализ результатов расчета для систем Та—С—F и Та—С—Si—O—F показывает, что, во-первых, в системе Та—С—F наблюдается существенная, в отличие от системы Та—С—Si—O—F, зависимость содержания ТаF₄ от общего давления в системе, причем содержание TaF₄ гораздо больше в системе Та—С—F для одних и тех же рассчитанных условий. Во-вторых, в системе Ta—C—Si—O—F перенос тантала из зоны источника в зону кристаллизации является не столь эффективным, как в системе Ta—C—F, поэтому можно ожидать падения выхода карбида тантала по реакции (3).

Из рис. 1 видно, что в качестве основного компонента в газовой фазе, равновесной с танталом, присутствует также оксофторид тантала $TaOF_3$. В зоне кристаллизации равновесное парциальное давление $TaOF_3$ уменьшается на несколько порядков по сравнению с зоной источника, одновременно содержание СО в газовой фазе над углеродом возрастает. Это может свидетельствовать в пользу реакций (4)—(6). Следует подчеркнуть, что образование СО делает вероятным процесс переноса углерода на тантал. Образование карбида тантала по реакции (5) наиболее предпочтительно с термодинамической точки зрения, однако нельзя исключать образование карбида тантала и по реакции (6):

$$TaOF_3 + C \leftrightarrow TaF_3 + CO, \quad K_p = 10^{-11} - 10^{-4},$$
 (4)

$$5\text{TaF}_3 + 2\text{C} \leftrightarrow 2\text{TaC} + 3\text{TaF}_5, \quad K_p = 10^{59} - 10^{32}.$$
 (5)

Реакции (4) и (5) дают в сумме реакцию (6)

$$5TaOF_3 + 7C \leftrightarrow 2TaC + 5CO + 3TaF_5, \quad K_p = 10^6 - 10^{15}.$$
 (6)

Рассмотрим состав газовой фазы, равновесной с SiO₂ (стенка кварцевого реактора). Данные термодинамического расчета (для компонентов, содержание которых превышает 10^{-8} Topp) представлены на рис. 3. Сравнение данных рис. 1 и 3 показывает, что в газовой фазе существенно увеличивается содержание TaOF₃, причем с увеличением температуры парциальное давление

Рис. 3. Основной состав газовой фазы в зоне над SiO₂ (стенкой кварцевого реактора)



оксофторида тантала становится больше, чем парциальное давление TaF₅. Рассчитанные конденсированные фазы включают SiO₂, TaO и Ta₂O₅.

Процесс травления кварцевого стекла SiO₂ пентафторидом тантала может быть описан реакциями (7), (8) и суммарной реакцией (9):

$$TaF_5 + SiO_2 \leftrightarrow TaOF_3 + SiOF_2, \quad K_p = 10^{-6} - 10^{-1}, \tag{7}$$

$$\operatorname{SiOF}_2 + \operatorname{TaF}_5 \leftrightarrow \operatorname{TaOF}_3 + \operatorname{SiF}_4, \quad K_p = 10^8 - 10^5, \tag{8}$$

$$\operatorname{SiO}_2 + 2\operatorname{TaF}_5 \leftrightarrow 2\operatorname{TaOF}_3 + \operatorname{SiF}_4, \quad K_p = 10^2 - 10^4.$$
(9)

При этом $SiOF_2$ может разлагаться по реакции (10) с образованием кристаллического SiO_2 , и таким образом может происходить перекристаллизация SiO_2

$$2\text{SiOF}_2 \leftrightarrow \text{SiO}_2 + \text{SiF}_4, \quad K_p = 10^{14} - 10^5.$$
 (10)

На основе данных термодинамического расчета, представленных на рис. 3, а также расчета константы равновесия, можно сделать вывод, что реакция разложения TaOF₃ (11), идущая с образованием твердого Ta₂O₅, становится маловероятной, особенно в области высоких температур

$$5 \text{TaOF}_3 \leftrightarrow \text{Ta}_2 \text{O}_5 + 3 \text{TaF}_5, \quad K_p = 10^3 - 10^{-4}.$$
 (11)

Таким образом, из приведенных данных по расчету равновесного молекулярного состава газовой фазы в зоне источника и зоне кристаллизации можно заключить, что SiO₂ оказывает существенное влияние на процесс карбидообразования. Это выражается в том, что, во-первых, в системе Та—С—Si—O—F перенос тантала из зоны источника в зону кристаллизации является не столь эффективным, как в системе Та—С—F; во-вторых, в системе Та—C—Si—O—F становится возможным двусторонний транспорт: тантала на углерод и углерода на тантал; в-третьих, усложняется состав конденсированных фаз, находящихся в равновесии с газовой фазой.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Эксперименты по реакционному осаждению в системе Та—С—Si—O— F проводили в двух вариантах. В первом варианте танталовая стружка (ТВЧ-1, ТУ 95.311-75, содержание Ta > 99,68 мас.% была плотно упакована в цилиндр из танталовой фольги, который, в свою очередь, помещали в цилиндр, изготовленный из фольги из терморасширенного графита марки ГФ-200-0,3/1,0-400. Коаксиально расположенные цилиндры загружали в кварцевую ампулу, которую затем нагревали в вакууме $5 \cdot 10^{-2}$ Topp до 1273 K, выдерживали при этой температуре 1 ч. После охлаждения ампулу заполняли газообразным CF₄ (хладон-14, ТУ 301-14-78-92) до давления 200 Topp. Затем ампулу запаивали, помещали в вертикальную печь, нагревали до T = 1273 K и выдерживали при этой температуре 24 ч. Зона изотермического нагрева совпадала с длиной ампулы. После самопроизвольного охлаждения ампулу вскрывали и анализировали полученные продукты.

Во втором варианте коаксиально расположенные цилиндры помещали в центральную часть трубчатого кварцевого реактора замкнутого типа длиной примерно 1 м. Реактор имел в центральной части изотермическую зону нагрева длиной 25 см, при этом концы реактора находились в холодной зоне. Эксперимент проводили при температуре изотермической зоны 1273 К в течение 24 ч при общем давлении CF₄ 760 Topp.

Микроструктуру и элементный состав продуктов изучали с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) на микроскопах TM-1000 (Hitachi Ltd, Japan) и Tescan Mira 3LM. Рентгенограммы записывали на дифрактометре Bruker D8 Advance в интервале углов $2\theta = 10$ — 90° (излучение Cu K_{α}). Качественный анализ дифрактограмм проводили с помощью базы данных ICDD PDF-2 (2008). Дифрактограммы монокристаллов были записаны на монокристальном дифрактометре DUO (Bruker, Germany), излучение Mo K_{α} , $\lambda = 0,7107$ Å. Дифрактограммы были проанализированы с помощью программного обеспечения APEX II.



Рис. 4. Рентгенограммы продуктов, образовавшихся в зоне источника (a) и зоне кристаллизации (b)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ продуктов, полученных в различных частях запаянной кварцевой ампулы, показал, что в зоне источника (танталовая фольга) образовался продукт матового серого цвета с оттенками побежалости. По данным РФА (рис. 4, *a*), кроме тантала (PDF# 40-14-0262), в составе налета присутствуют фазы Ta₂Si (PDF# 40-04-7298), Ta₂C (PDF# 40-01-3360), TaO (PDF# 78-724) и Ta₂O₅ (PDF# 40-13-9608). Образование Ta₂O₅ на металлическом тантале свидетельствует о протекании реакции (1). Образование Ta₂Si возможно по реакциям взаимодействия фторидов кремния с танталом.

Из представленной на рис. 4, δ рентгенограммы видно, что основным продуктом на графитовой фольге является TaC (PDF# 35-801), который может образоваться в результате взаимодействия низших фторидов тантала с углеродом. Нельзя исключать образование монокарбида тантала по реакции оксофторида с углеродом (реакция 6). В качестве примесной фазы в продукте обнаружен Ta₂O₅ (PDF# 40-13-9608). Так как согласно термодинамическим расчетам, парциальное давление оксофторида тантала в газовой фазе в зоне кристаллизации мало, то и присутствие Ta₂O₅ в зоне углерода незначительно, что согласуется с данными РФА. На кварцевой стенке формируется конденсат в виде сероватой хрупкой оболочки, в состав которого входит в основном кристобалит (PDF# 40-08-8640) с небольшой примесью кварца (PDF# 10-85-0459, PDF# 10-70-3755), а также Ta₂O₅ (PDF# 40-13-9608) (рис. 5). Таким образом, экспери-





Рис. 6. РФА продукта, образовавшегося на холодных концах графитовой фольги





Рис. 7. Оптический (*a*) и электронно-микроскопические снимки (*б*, *в*) конденсата, образовавшегося на холодных концах графитовой фольги

ментальные результаты подтверждают предположения, выдвинутые на основании результатов термодинамического моделирования о возможной перекристаллизации SiO₂ по реакции (10).

В реакторе второго типа (с холодными концами) на танталовой фольге образовывался лишь ТаС, а в горячей зоне кристаллизации — также только ТаС. Причиной различного состава продуктов, обнаруженных в двух типах реакторов, является тот факт, что в реакторе с холодными концами газообразный TaOF₃ формируется на холодных концах реактора по реакции (9) и затем диффундирует в горячую реакционную зону. Газообразный TaOF₃ разлагается на концах графитовой фольги с образованием мелких кристаллов синего цвета, которые, согласно РФА, представляли собой смесь Ta₃O₇F и Ta₂O₅ (рис. 6 и 7, *a*). Ввиду того, что рефлексы, принадлежащие Ta₂O₅, имеют меньшую интенсивность и заметное уширение, можно осторожно предположить, что наблюдаемая на СЭМ снимке мелкокристаллов, разориентированных на подложке из графойла (см. рис. 7, *б*, *в*), относится к фазе Ta₃O₇F (PDF# 74-1819).

Результаты проведенного рентгеноструктурного исследования образца показали, что в лауэграмме присутствуют 110 пиков, из которых 73 пика соответствуют кристаллической решетке Ta_3O_7F (рис. 8, *a*, *б*). Остальные могут принадлежать наростам (вероятно, фрагменты Ta_2O_5). Из полученных данных были определены тип и параметры кристаллической решетки Ta_3O_7F . Орторомбическая ячейка имеет параметры a = 6,42(7), b = 10,58(13), c = 3,97(4) Å, V = 270(8) Å³. Полученные данные хорошо согласуются с литературными данными для Ta_3O_7F [11].

На рис. 9 представлены СЭМ снимки Ta_3O_7F кристаллов, образующихся в условиях RCVD. Основной особенностью роста этих кристаллов является образование большого количества двойников — закономерно разориентированных областей кристалла. Анализ СЭМ снимка показывает, что операцией симметрии, связывающей двойники, является, по-видимому, отражение в плоскости. Кроме того, пересечение двойников приводит к растрескиванию кристалла в местах пересечения (см. рис. 9, *a*).



Рис. 8. Оптический снимок (*a*) и лауэграмма монокристалла Ta₃O₇F (*б*). Черными кругами отмечены сигналы Ta₃O₇F фазы



Рис. 9. СЭМ снимки двойниковых кристаллов Та₃O₇F

Образование Ta₂O₅ и Ta₃O₇F фаз может быть обусловлено реакциями разложения TaOF₃, протекающими в соответствии с уравнениями (12) и (13). Согласно термодинамическим расчетам, при температуре $T \le 1200$ K реакция (13) более вероятна, чем реакция (12), а при температуре $T \ge 1400$ K — наоборот, более вероятной становится реакция (12).

$$5\text{TaOF}_{3(\Gamma)} \leftrightarrow \text{Ta}_2\text{O}_{5(\Gamma)} + 3\text{TaF}_{5(\Gamma)},$$
 (12)

$$7\text{TaOF}_{3(r)} \leftrightarrow \text{Ta}_{3}\text{O}_{7}\text{F}_{(r)} + 4\text{TaF}_{5(r)}.$$
(13)

В целом можно заключить, что RCVD метод позволяет в одну стадию воспроизводимо получать достаточно чистый монокристаллический оксофторид тантала Ta₃O₇F.

выводы

Проведено термодинамическое моделирование системы Ta—C—Si—O—F в широком интервале температур и давлений. Показано, что SiO₂ оказывает существенное влияние на процесс карбидообразования. Это выражается в уменьшении эффективности переноса тантала из зоны источника в зону кристаллизации, в возможности двустороннего транспорта тантала на углерод и углерода на тантал, в усложнении состава конденсированных фаз, находящихся в равновесии с газовой фазой. В системе Ta—C—Si—O—F становится возможным перенос кислорода из кварца в зону источника и кристаллизации, который осуществляется через газообразный TaOF₃. Показано, что RCVD методом в системе Ta—C—Si—O—F можно получить монокристаллический оксофторид тантала Ta₃O₇F.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта И-38 РАН (2017 г).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Schäfer H. Chemische Transportreaktionen. Germany, GmbH: Verlag Chemie, 1962.
- 2. Binnewies M., Glaum R., Schmidt M., Schmidt P. Chemische Transportreaktionen. Berlin, 2012.
- 3. Baklanova N.I., Zaitsev B.N., Titov A.T., Zima T.M. // Carbon. 2008. 46, N 2. P. 261.
- 4. Лозанов В.В., Сысоев С.В., Бакланова Н.И. // Неорган. матер. 2015. 51, № 7. С. 746.
- 5. Лозанов В.В., Сысоев С.В., Бакланова Н.И. // Неорган. матер. 2016. 52, № 7. С. 718.
- 6. Бакланова Н.И., Кулюкин В.Н. // Изв. АН СССР. Сер. Неорган. материалы. 1990. **26**, № 1. С. 97.
- 7. Xu L., Gong H., Deng L., Long F., Gu Y., Guang J. // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2016. 8. P. 9395.
- 8. Zhang H., Li Y., Wang Y., Liu P., Yang H., Yao X., An T., Wood B. J., Zhao H. // J. Mater. Chem. A. 2013. – 1. – P. 6563.
- 9. *Фундаментальные* основы процессов химического осаждения пленок и структур для наноэлектроники / Ред. Т.П. Смирнова – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2013.
- 10. Baier R.W., Oliver R.C. http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/425887.pdf
- Vlasse M., Morilière C., Chaminade J.-P., Pouchard M. // Bull. Soc. Fr. Minéral. Cristallogr. 1975. 98. – P. 325.